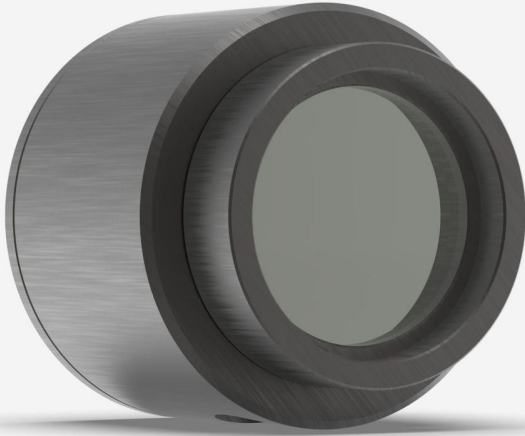


PH20-GE-OD2-D0

최대 500 mW의 레이저 파워 계측용 광전다이오드 검출기.



주요 특징

LARGE APERTURES

10 mm Ø for the silicon sensors

3 VERSIONS

- Silicon 350 - 1080 nm, up to 750 mW
- Silicon-UV 210 - 1080 nm, up to 38 mW
- Germanium 800 - 1650 nm, up to 500 mW

CHOICE OF ATTENUATORS

- OD0.3: 50% transmission (for PH100-SI^{UV} only)
- OD1: 10% transmission
- OD2: 1% transmission

HIGH ACCURACY

The new PH100-SI-HA presents the lowest calibration uncertainty to date.

PRECISE CALIBRATION

Wavelength selection in 1 nm steps

SMART INTERFACE

Containing all the calibration data

호환 스탠드

[STAND-D-233](#)

사양

계측 성능	
최대 평균 파워 ¹	500 mW
등가노이즈파워 (NEP) ²	6 nW
스펙트럼 범위	950 - 1650 nm
일반 상승 시간	0.2 sec
파워 교정 불확정성 ³	±5.0 % (950 - 1559 nm) ±7.0 % (1560 - 1650 nm)
첨두 강도	0.98 A/W @ 1550 nm

1. 1310nm의 감쇠기. 다른 파장에서 최대 출력 곡선을 참조하십시오.
2. 1550nm. 액면 값. 실제 값은 환경의 전자파 간섭 및 파장에 따라 달라집니다.
3. 감쇠기. 비감쇠기 교정에 대하여 불확실할 경우 사용자 설명서를 참조하십시오.

손상 한계	
최대 평균 파워 밀도	100 W/cm ²
물리적 특성	
구경 지름	5 mm
업소버	Ge
치수	38.10 x 36D mm
중량	0.14 kg
센서면까지의 거리	10.5 mm

ORDERING INFORMATIONS

PH20-Ge-OD2-D0	200875
PH20-Ge-OD2-INT-D0	202798

INTERESTED IN THIS PRODUCT?

견적받기

Find your local sales representative at gentec-eo.com/contact-us